

МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО ОТКЛИКА ФОТОННЫХ ИЗОМЕРОВ С NV-ЦЕНТРАМИ. ЧАСТЬ II

Цуканов А.В.

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ ЯЧЕЕК DICE ДЛЯ СБООУСТОЙЧИВЫХ КМОП 28 НМ ОЗУ

Стенин В.Я., Степанов П.В.

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЧ GAAS МОНОЛИТНОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ МАЛОШУМЯЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ С МЕДНОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ

Ишуткин С.В., Кагадей В.А., Ерофеев Е.В., Анищенко Е.В., Арыков В.С.

СОЗДАНИЕ ЛИТОГРАФИЧЕСКИХ МАСОК С ПОМОЩЬЮ СКАНИРУЮЩЕГО ЗОНДОВОГО МИКРОСКОПА

Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Зиганшина С.А., Нургазизов Н.И., Ханипов Т.Ф., Чукланов А.П.

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОЗИТИВНОГО ФОТОРЕЗИСТА ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Бринкевич Д.И., Бринкевич С.Д., Лукашевич М.Г., Просолович В.С., Оджаяев В.Б., Янковский Ю.Н.

РАСЧЕТ ВЫСОТЫ БАРЬЕРА ШОТКИ НА КОНТАКТЕ МЕТАЛЛА С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ТВЕРДЫМ РАСТВОРОМ (SiC)_{1-x}(AlN)_x

Сафаралиев Г.К., Билалов Б.А., Курбанов М.К., Алтухов В.И., Касьяненко И.С., Санкин А.В.

АТОМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕЛАКСАЦИИ УПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ Cu/Ni(001)

Трушин О.С., Куприянов А.Н., Инг С.Ч., Гранато Э., Ала-Ниссила Т.

АДАПТИВНЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР С КОНТРОЛЛЕРОМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА И ПСЕВДО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ КАСКОДНЫМ ВЫХОДНЫМ БУФЕРОМ ДЛЯ 10 ГБ/С ПЕРЕДАТЧИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ КМОП 65 НМ

Ларионов А.В.

РАЗРАБОТКА КРИСТАЛЛА МАТРИЦЫ ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫХ ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ

Гусев Д.В., Литвиненко Р.С., Суханов В.С.

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР НА ОСНОВЕ ТИТАНАТА СТРОНЦИЯ, СФОРМИРОВАННОГО ЗОЛЬ–ГЕЛЬ МЕТОДОМ

Сохраби Анараки Х., Гапоненко Н.В., Руденко М.В., Колос В.В., Петлицкий А.Н., Турцевич А.С.